**Nazwa przedmiotu:**

HES - Ochrona własności intelektualnej

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Krzysztof Gradkowski

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia II stopnia

**Program:**

Budownictwo

**Grupa przedmiotów:**

HES

**Kod przedmiotu:**

OWINTE

**Semestr nominalny:**

4 / rok ak. 2019/2020

**Liczba punktów ECTS:**

1

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Wykład 8 godz.
Przygotowanie do wykładu 17 godz.
Razem 25 godz.

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Wykład 8 godz.
0,5 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 8h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Brak

**Limit liczby studentów:**

Brak

**Cel przedmiotu:**

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z systemem ochrony własności intelektualnej. Student pozna źródła prawa, ogólne pojęcia i zagadnienia z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej. Student będzie umiał rozróżniać rodzaje własności intelektualnej, wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej. Słuchacz będzie także miał świadomość znaczenia i zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej.

**Treści kształcenia:**

Wykład ma za zadanie zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami z ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego, takimi jak:
• krajowe źródła prawa ochrony własności intelektualnej;
• ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej;
• podział praw własności intelektualnej;
• osobiste i materialne prawa autorskie;
• zdolność patentowa - wymogi uzyskania ochrony patentowej;
• informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych;
• praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony patentowej;
• ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem.

**Metody oceny:**

Zaliczenie wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru.

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami);
• Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 ze zmianami);
• G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012;
• J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010;
• E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010.

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt zaliczenie w formie kolokwium:**

Student zna system ochrony własności intelektualnej, zna źródła prawa, ogólne pojęcia i zagadnienia z zakresu ochrony prawnej własności intelektualnej. Student umie rozróżniać rodzaje własności intelektualnej, wskazywać i charakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej. Słuchacz ma świadomość znaczenia i zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej.

Weryfikacja:

OWINTEW1

**Powiązane efekty kierunkowe:** K2\_W09

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_W10

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt OWINTEU1:**

Student umie zidentyfikować rodzaj dobra niematerialnego i wskazać możliwe ścieżki jego ochrony, ma świadomość znaczenia ochrony własności intelektualnej, dostrzega i definiuje rolę praw wyłącznych we współczesnym świecie.

Weryfikacja:

zaliczenie w formie kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt OWINTK01:**

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Student umie docenić potrzebę stosowania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, ma świadomość konsekwencji wkroczenia, nawet niezawinionego, w prawa wyłączne bez stosownego upoważnienia.

Weryfikacja:

zaliczenie w formie kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K2\_K03, K2\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T2A\_K05, T2A\_K07, T2A\_K02